

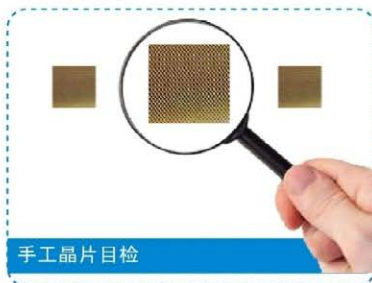
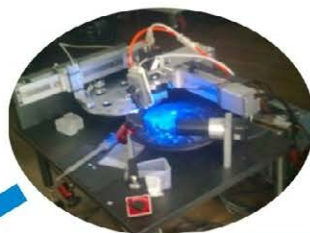
行业/机械设备应用

电子/晶片自动检测设备

产品应用

PFMV530流量开关/PFMV300显示器

自动晶片检测设备



手工晶片目检

应用:

采用放大镜进行晶片外观的目检, 包括晶片上是否有刮伤/压伤、崩裂/角崩、切割不良等, 目检错误率较高, 效率也有限。
 要提升生产效率, 采用自动化方式进行晶片检测。为此要将极小的晶片摆放在视觉检测系统中的高清镜头下进行晶片外观的检测, 判断晶片是否为合格品。
 由于被检测晶片大小只有1mm-5mm, 管道也很细小, 晶片是否被吸着, 从真空压力上很难分辨(压力差异太小, 如图1)。而用PFMV流量开关来确认晶片的吸着与否, 因流量值差异大(如图2), 易于判断, 效果非常好。



流量开关



显示器

PFMV系列流量开关产品特点:

- 分体式
- 用于微小工件吸着确认
- 无油、符合RoHS认证
- 流量开关不同流量范围产品, 使用同一种显示器

图1

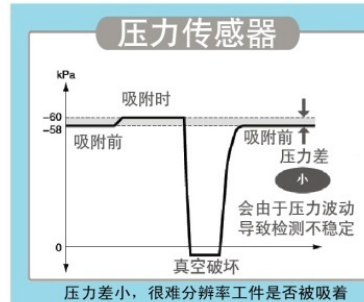
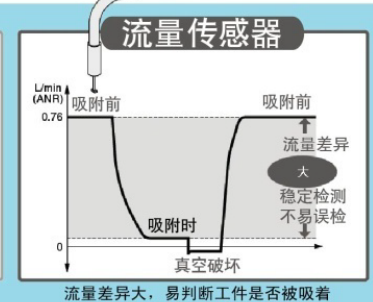


图2



成功应用于

成功应用于晶片自动检测设备上, 有效确认晶片的吸著。

注: 特别选项详情请咨询SMC